

SCAN TECH 2026 のお知らせ

2026年7月吉日
公益社団法人 日本顕微鏡学会
走査電子顕微鏡分科会

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
今年度は、「“見える”を“わかる”に変える ～SEM 前処理条件と解析技術～」をテーマとして SCAN TECH 2026 を開催することになりました。各分野の最前線でご活躍の方々に講演をお願い致しました。具体的な内容は裏面のプログラムをご覧ください。さらに、講演会終了後のポスターセッション&フリートキングでは、講師やスタッフあるいは参加者同士が自由に討議できる時間を確保してあります。

記

1. 主催：公益社団法人 日本顕微鏡学会 走査電子顕微鏡分科会
2. 日時：2026年8月28日（金） 10:00～18:30
3. 場所：東京都市大学 世田谷キャンパス（東京都世田谷区玉堤 1-28-1）7号館
交通
・東急大井町線 尾山台下車：徒歩 12 分
・東急東横線/多摩川線 多摩川駅下車→東急バス（二子玉川駅行）東急ゴルフパークたまがわ前・東京都市大南入り口下車：徒歩 3 分
・東急田園都市線 二子玉川駅下車→東急バス（多摩川駅行）東急ゴルフパークたまがわ前・東京都市大南入り口下車：徒歩 3 分
・東急東横線 田園調布駅下車→東急バス（千歳船橋駅行）東京都市大北入り口下車：徒歩 5 分
4. 参加費：予稿集を含みます。予稿集は PDF ファイルをダウンロード
：日本顕微鏡学会会員 4,000 円（税込）、非学会員 8,000 円（税込）
：日本顕微鏡学会会員学生 無料
5. 登録方法：分科会ホームページ：<http://scantech.jp>（7月より受付開始）
6. 登録締め切り：2026年8月3日（月）
（当日の参加登録は受け付けておりませんのでご注意ください。）

周囲に関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。

なお、最新の情報は走査電子顕微鏡分科会のホームページをご覧ください。

URL：<http://scantech.jp>

来年度の案内を E-mail でご希望の方は chizu.mitsui@oxinst.com までご連絡下さい。

プログラムは次頁を参照ください。

SCAN TECH 2026

“見える”を“わかる”に変える

～SEM 前処理条件と解析技術～

日時：2026年 8月 28日（金）10:00～18:30

場所：東京都市大学 世田谷キャンパス

開会挨拶（10:00～10:10）

許斐 麻美（株式会社日立ハイテク）

基礎講座（10:10～11:20）

1. 観察前に気にするいくつかのこと。～観察できればいいんです～

徳永 智春（名古屋大学）

2. ImageJで始めるSEM画像解析 ～AI全盛期にこそ問われる基礎的アプローチ～

上村 逸郎（株式会社マックスネット）

特別講演Ⅰ（11:20～12:00）

3. 岩石鉱物学における分析用試料の作製手順の一例

野村 秀彦（北海道大学）

ポスター・企業展示&休憩（12:00～13:10）

特別講演Ⅱ（13:10～13:50）

4. 画像処理AIのトレンドとSEM画像解析への適用事例紹介

柿下 容弓（株式会社日立製作所）

応用講座Ⅰ（13:50～14:25）

5. CNNを用いたSEM/EBSD画像分析による損傷評価の試み

山崎 泰広（千葉大学）

出展社ご紹介（14:25～14:45）

ポスター・企業展示&休憩（14:45～15:05）

応用講座Ⅱ（15:05～15:40）

6. ボリューム電子顕微鏡で「みえる」を「分かる」に変える ～3次元構造のさらなる理解のための観察・解析技術～

大野 伸彦（自治医科大学）

特別講演Ⅲ（15:40～16:20）

7. 走査電子顕微鏡における“分解能”とその評価

熊谷 和博（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

トピックス（16:20～16:30）

8. ソフトマテリアル分科会開催ラウンドロビンテストのご紹介

許斐 麻美（株式会社日立ハイテク）

閉会挨拶

三井 千珠（オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社）

ポスター&企業展示、フリートーク（～18:30）